

課題番号 : F-13-WS-0086  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名 (日本語) : 多糖類基材への ALD によるアルミナ製膜  
Program Title (English) : Alumina deposition by ALD on polysaccharide substrates  
利用者名 (日本語) : 盤指 豪, 岩井 信乃  
Username (English) : S. Iwai, G. Banzashi  
所属名 (日本語) : 王子ホールディングス株式会社  
Affiliation (English) : Oji Holdings Corporation

## 1. 概要 (Summary)

多糖類基材への ALD によるアルミナ製膜検討を検討する。多糖類基材は水酸基の多さから、高湿度環境下で膨潤しやすい。この点を改善するため、アルミナ製膜を行い、水蒸気に対する耐性を付与したい。

ALD の適用可能性を調べるため、真空中加熱を行い、真空度の悪化を測定した。その結果、5 時間後も真空度の悪化が収まらず、ALD での製膜は不相当と判断し、別途、スパッタ法を検討する。

## 2. 実験 (Experimental)

なし。

## 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

なし。

## 4. その他・特記事項 (Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許 (Patent)

なし。